PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-074170

(43) Date of publication of application: 16.03.1999

(51)Int.CI.

H01L 21/02 G05B 19/048 G05B 23/02 G06F 3/00

G06F 17/60

(21)Application number : 10-168160

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing:

16.06.1998

(72)Inventor: MATSUDA KATSUHIKO

NAKAMA KAZUHISA

TODATE SHIGENORI

(30)Priority

Priority number: 09164287

Priority date : 20.06.1997

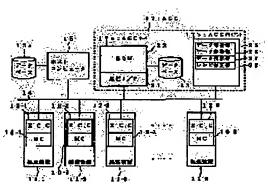
Priority country: JP

(54) CONTROL SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a system which unitarily controls processing devices that process semiconductor wafers to be improved in maintainability.

SOLUTION: An AGC(advanced group controller) 17, which not only has central control of the recipes (processing condition) of each processing device 11 and processing control over the processing devices 11 but also carries out the central monitoring and processing of all processing data obtained from the processing devices 11 is, added and connected to a control system. All the processing data obtained from the processing devices 11 can be monitored intensively, so that abnormalities or deteriorations of the processing devices 11 can be found more precisely and quickly by this system than by a conventional system, where processing data are monitored in a centralized way through a host computer. A hardware which collects and monitors processing data is separated into a server device 17a and a client device 17b, so that a control load on the AGC 17 is divided, and processing devices which can be connected to this control system can be increased in number.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-74170

(43)公開日 平成11年(1999) 3月16日

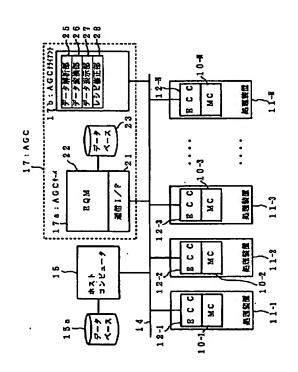
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI
H01L 21/02	1	H 0 1 L 21/02 Z
G05B 19/04	8	G 0 5 B 23/02 3 0 1 N
23/02	301	G 0 6 F 3/00 6 5 2 C
G06F 3/00	6 5 2	G O 5 B 19/05 D
17/60		G 0 6 F 15/21 R
		審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特顏平10-168160	(71) 出願人 000219967
		東京エレクトロン株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 6月16日	東京都港区赤坂5丁目3番6号
		(72)発明者 松田 克彦
(31)優先権主張番号	→ 特願平9-164287	東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレ
(32)優先日	平 9 (1997) 6 月20日	クトロン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 中間 和久
		東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレ
		クトロン株式会社内
		(72)発明者 戸館 重典
		東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレ
		クトロン株式会社内
		(74)代理人 弁理士 須山 佐一

(54)【発明の名称】 制御システム

(57)【要約】

【課題】 半導体ウエハを処理する複数の処理装置を一 元的に制御するシステムの保守性の向上を図る。

【解決手段】 各処理装置毎のレシビ(プロセス条件値)の集中管理やプロセスコントロールをはじめとして、各処理装置11から得られる全プロセスデータの集中モニタリング処理等を行うAGC(アドバンス・グループ・コントローラ)を制御システムに付加接続する。各処理装置11から得られる全プロセスデータを集中モニタリングできることで、従来のホストコンピュータ上でプロセスデータを集中モニタリングする方式に比べ、処理装置の異常や劣化状態をより詳細かつ早期に発見することができる。また、プロセスデータを収集、モニタリングするハードウェアをサーバ装置とクライアント装置とに分離し、AGCの制御負荷を分散化したことで接続可能な処理装置数を増加することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に対して所定の処理を行う複数の処 理装置を個別に制御する複数の制御装置と、

1

前記制御装置の各々で生成されたほぼ全てのプロセスデ ータを取り込んで蓄積する蓄積部を有するサーバ装置 と、前記サーバ装置から前記蓄積されたプロセスデータ を取り込み編集する編集部と、編集データを表示する表 示部を有するクライアント装置を含むコントロール装置

を有することを特徴とする制御システム。

【請求項2】 前記制御装置は、ホストコンピュータか らのコマンドに応答して対応する前記処理装置をそれぞ れ制御することを特徴とする請求項1記載の制御システ

【請求項3】 前配クライアント装置は、前記プロセス データの解析処理および統計処理を行うデータ解析部 と、取り込んだプロセスデータやその解析結果をユーザ が利用し、加工できる形式のデータに変換するデータ変 換部と、変換データを表示する前記表示部と、被処理基 板上の膜厚等の測定データを含むプロセスデータの解析 20 ることを特徴とする請求項7記載の制御システム。 結果に基づいてレシピを最適化するように更新するレシ ビ修正部を含むことを特徴とする請求項1記載の制御シ ステム。

【請求項4】 前記制御装置の各々は、ホストコンピュ ータからのコマンドを受けて前記処理装置を制御すると 共に前記処理装置から得た全てのプロセスデータの中か **ら予め設定された一部の種類のプロセスデータだけを選** 択してホストコンピュータに送信する制御部を有すると とを特徴とする請求項1記載の制御システム。

するメモリと、このメモリから取り出された予め設定さ れた一部の種類のプロセスデータを一時格納するバッフ ァと、このバッファの内容をまとめてホストコンピュー タに送信するインターフェースと、前記メモリの全プロ セスデータを前記コントロール装置に送信するインター フェースとを有することを特徴とする請求項4記載の制 御システム。

【請求項6】 前記サーバ装置は、予め定義されたブロ セス条件と前記処理装置の各々から得られるプロセスデ ータに基づいて処理装置毎のプロセスの各種パラメータ 40 の補正を行うとともに、受信したパラメータを前記蓄積 部へ格納し、前記クライアント装置に転送すべきプロセ スデータを前記蓄積部から検索する処理を行うことを特 徴とする請求項1記載の制御システム。

【請求項7】 複数のグループに分けられ、基板に対し て所定のプロセスを行う複数の処理装置をホストコンピ ュータと関連して個別に制御する複数の制御装置と、 前記処理装置のグループ毎に対応して設けられ、前記制 御装置の各々で生成されたほぼ全てのプロセスデータを 取り込んで蓄積する蓄積部を有する複数のサーバ装置

と、前記サーバ装置から前記蓄積されたプロセスデータ を取り込み編集する編集部と、編集データを表示する表 示部を有するクライアント装置とを含むコントロール装

を有することを特徴とする制御システム。

【請求項8】 前記クライアント装置は、前記プロセス データの解析処理および統計処理を行うデータ解析部 と、取り込んだプロセスデータやその解析結果をユーザ が利用し、加工できる形式のデータに変換するデータ変 10 換部と、変換データを表示する前記表示部と、前記基板 上の膜厚の測定データを含むプロセスデータの解析結果 に基づいてレシピを最適化するように更新するレシピ修 正部を含むことを特徴とする請求項7記載の制御システ

【請求項9】 前記制御装置の各々は、前記ホストコン ピュータからのコマンドを受けて前記処理装置を制御す ると共に前記処理装置から得た全てのプロセスデータの 中から予め設定された一部の種類のプロセスデータだけ を選択してホストコンピュータに送信する制御部を有す

・【請求項10】 前記制御部は、全プロセスデータを蓄 積するメモリと、とのメモリから取り出された予め設定 された一部の種類のプロセスデータを一時格納するバッ ファと、このパッファの内容をまとめてホストコンピュ ータに送信するインターフェースと、前記メモリの全プ ロセスデータを前記コントロール装置に送信するインタ ーフェースを有することを特徴とする請求項9記載の制 御システム。

【請求項11】 前記サーバ装置は、予め定義されたブ 【請求項5】 前記制御部は、全プロセスデータを蓄積 30 ロセス条件と前記処理装置の各々から得られるプロセス データに基づいて処理装置毎のプロセスの各種バラメー タの捕正を行うとともに、受信したパラメータを前記蓄 **積部へ格納し、前記クライアント装置に転送すべきブロ** セスデータを前記蓄積部から検索する処理を行うことを 特徴とする請求項7記載の制御システム。

> 【請求項12】 前記クライアント装置は同じグループ 内の前記処理装置に対応する前記制御装置に同じレシピ をコピーする機能を有することを特徴とする請求項7記 載の制御システム。

【請求項13】 各々が同一のプロセス条件に設定され た複数の処理装置を含む複数のグループに分けられ、基 板に対して所定のプロセスを行う複数の処理装置をホス トコンピュータと関連して個別に制御する複数の制御装 置と、

前記グループ毎に対応して設けられ、プロセスデータを 取り込み、編集する手段および変換データを表示する手 段を有するクライアント装置を含むコントロール装置 Ł.

を有することを特徴とする制御システム。

50 【 請求項 14 】 基板に対する所定のプロセスを行う複 3

数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、 前記制御装置の各々で生成された一部のプロセスデータ に基づいて前記制御装置を制御するホストコンピュータ Ł.

同一のプロセス条件が設定された処理装置のグループ毎 に対応して設けられ、各制御装置で生成されたほぼ全て のプロセスデータを取り込んで蓄積する手段を有する複り 数のサーバ装置と、前記サーバ装置から前記蓄積された プロセスデータを取り込み、編集するクライアント装置 と、編集データを表示する手段とを有するクライアント 10 装置を含むコントロール装置と、

を具備することを特徴とする制御システム。

【請求項15】 基板に対して所定のプロセスを行う複 数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、

前記制御装置の各々より受信したプロセスデータに基づ いて前記制御装置の各々を制御するホストコンピュータ Ł.

前記制御装置の各々より受信したプロセスデータを収集 する手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段 および前記解析の結果を出力する手段を有するコントロ 20 ール装置と、

を具備し、

前記制御装置の各々は、プロセスデータを生成する手 段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定さ れた一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに 送信する手段および前記生成された全てのプロセスデー タを前記コントロール装置に送信する手段を有すること を特徴とする制御システム。

【請求項16】 前記コントロール装置は、前記収集し たプロセスデータの内で前記ホストコンピュータが受信 30 不能となった期間での欠落プロセスデータを補填する手 段を有することを特徴とする請求項15記載の制御シス テム。

【請求項17】 基板に対して所定のプロセスを行う複 数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、 前記制御装置の各々より受信したプロセスデータに基づ いて前記制御装置を制御するホストコンピュータと、 前記制御装置の各々より受信したプロセスデータを収集 する手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段 および前記解析の結果に基づいて各処理装置のプロセス 40 条件を更新する手段を有するコントロール装置と、 を具備し、

前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手 段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定さ れた一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに 送信する手段および前記生成された全てのプロセスデー タを前記コントロール装置に送信する手段を有すること を特徴とする制御システム。

【請求項18】 前記コントロール装置は、前記収集し

不能となった期間での欠落プロセスデータを捕填する手 段を有することを特徴とする請求項17記載の制御シス

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体製造 装置、液晶パネル製造装置等の製造装置を制御するシス テムに係り、特に複数の基板処理装置を一元管理する機 能を持つた制御システムに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体ウエハや液晶パネル等の製 造システムの大規模化により、被処理基板に対して成膜 処理、エッチング処理、熱酸化処理等の処理(プロセ ス)を行う多数の処理装置を一元管理する要求が益々高 まっている。

【0003】複数の処理装置を一元管理する機能を持っ た従来の制御システムによると、被処理基板に対して各 種処理を行う処理装置は、ECC制御部によって個別に 制御される。ECC制御部は、ホストコンピュータとの 論理的なインターフェイス手段であるHCIを有し、と のHCIによって、ホストコンピュータとの間での各種 データのやりとりがTCP/IP等のデータ伝送系を通 じて行われる。ホストコンピュータは、各処理装置のE CC制御部との間で各種データのやりとりを通じて各処 理装置のトラッキング処理を行うとともに、各処理装置 より受信したプロセスデータをデータベースに履歴とし て蓄積し、その内容をモニタに表示したり、そのプロセ スデータに基づいて処理装置の各種パラメータ捕正や塁 常検出などを行う。

【0004】各処理装置のECC制御部からポストコン ピュータへのプロセスデータ転送の際、HCIは、EC C制御部にて生成された全プロセスデータの中からトラ ッキング処理、パラメータ補正、異常検出等に最低限必 要とされる一部の種類のデータだけを選択してポストコ ンピュータに送信する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな制御システムによる一元管理方式では、ポストコン ピュータに蓄積されるプロセスデータが限定されること になり、モニタに表示されたプロセスデータから各処理 装置の状態として獲得できる情報も制限されたものとな る。また、処理装置の経年的な特性の劣化状態を反映し たプロセスデータの変化等は、モニタに表示されたプロ セスデータを単に参照しただけでは発見できない場合が 多い。このような事情から、処理装置の異常や特性劣化 を確実且つ早期に発見することは現実的に難しいという 問題があった。

【0006】本発明は、より詳細なプロセスデータの集 中モニタリングを実現して、処理装置の異常や特性劣化 たプロセスデータの内で前記ホストコンピュータが受信 50 の早期発見に寄与することのできる制御システムを提供 5

することを目的としている。

【0007】また、本発明は、各処理装置のより詳細な一元管理を実現して保守性の向上を図れる制御システムの提供を目的としている。

【0008】また、本発明は、プロセスデータの解析結果を通しての各処理装置の詳細な一元管理を実現して、 処理装置の異常や特性劣化の早期発見に寄与することの できる制御システムの提供を目的としている。

【0009】本発明は、各処理装置のプロセス条件の自動的な最適化を実現した制御システムを提供することを 10目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上気した目的を達成するために、本発明は、基板に対して所定の処理を行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記制御装置の各々で生成されたほぼ全てのブロセスデータを取り込んで蓄積するメモリを有するサーバ装置と、このサーバ装置から蓄積されたプロセスデータを取り込み編集する編集部と、編集データを表示する表示部を有するクライアント装置を含むコントロール装置とにより構成 20される制御システムを提供する。

【0011】すなわち、この発明において、コントロー ル装置のサーバ装置は各制御装置から取り込んだプロセ スデータを蓄積する。クライアント装置はサーバ装置に 蓄積されているプロセスデータを取り込み、これを自ク ライアント装置上で利用可能な形式のデータに変換して 表示する。サーバ装置に蓄積されているプロセスデータ は、各処理装置のほぼ全てのプロセスデータであり、従 来のホストコンピュータ上でプロセスデータを集中モニ タリングする方式に比べ、より詳細なプロセスデータの 30 集中モニタリングが可能となり、処理装置の異常や特性 劣化を早期に発見することが可能となる。また、プロセ スデータを収集、表示するコントロール装置のハードウ ェアをサーバ装置とクライアント装置とに分離し、プロ セスデータの収集、表示のための制御負荷を分散化した ことで、接続可能な処理装置数を増加することができ る。

【0012】また、本発明は、複数のグループに分けられ、基板に対して所定のプロセスを行う複数の処理装置をホストコンピュータと関連して個別に制御する複数の 40制御装置と、処理装置のグループ毎に対応して設けられ、制御装置の各々で生成されたほぼ全てのプロセスデータを取り込んで蓄積するメモリを有する複数のサーバ装置と、これらサーバ装置から蓄積されたプロセスデータを取り込み編集する編集部と、編集データを表示する表示部を有するクライアント装置とを含むコントロール装置とにより構成される制御システムを提供する。

【0013】さらに、本発明は、基板に対する所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記制御装置の各々で生成された一部のプロ 50

6

セスデータに基づいて前記制御装置を制御するホストコンピュータと、同一のプロセス条件が設定された処理装置のグループ毎に対応して設けられ、各制御装置で生成されたほぼ全てのプロセスデータを取り込んで蓄積する手段を有する複数のサーバ装置と、前記サーバ装置から前記蓄積されたプロセスデータを取り込み、編集するクライアント装置と、編集データを表示する手段とを有するクライアント装置を含むコントロール装置とを具備する制御システムを提供する。

【0014】本発明によれば、ブロセスデータを蓄積するサーバ装置を、予め決められた処理装置のグルーブ毎、例えば同一のプロセス条件が設定された処理装置毎に設けたことで、接続可能な処理装置数をさらに増加させることができるとともに、個々のサーバ装置の機能をパージョンアップしたり保守点検を行う際に、他のサーバ装置の管理下にある処理装置群の動作を止める必要がなくなる。

【0015】本発明は、被処理基板に対する所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、各制御装置より受信したプロセスデータに基づいて各制御装置を制御するホストコンピュータと、各制御装置より受信したプロセスデータを収集し、前記収集したプロセスデータを解析し、解析の結果を出力するコントロール装置とを具備し、個々の制御装置は、プロセスデータを生或する手段と、生成されたプロセスデータの中から予め設定された一部のプロセスデータをホストコンピュータに送信する手段と、生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段を有する、制御システムを提供する。

【0016】すなわち、との発明において、コントロール装置は各処理装置の制御装置で生成された全てのプロセスデータを解析してその結果を出力するので、従来のホストコンピュータ上で一部のプロセスデータを集中モニタリングする方式に比べ、各処理装置の状態として掴み得る情報の幅が広がり、各処理装置の状態の経時的な変化も早期に発見することができる。

【0017】また、本発明は、被処理基板に対する所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、各制御装置より受信したプロセスデータに基づいて各制御装置を制御するホストコンピュータと、各制御装置より受信したプロセスデータを収集し、前記収集したプロセスデータを解析し、前記解析の結果に基づいて各処理装置のプロセス条件を更新するコントロール装置とを具備し、前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手段と、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定された一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに送信する手段と、前記生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段とを有する、制御システムを提供する。

50 【0018】との発明は、各制御装置にて生成された全

てのプロセスデータの解析結果に基づいてプロセス条件 を更新する手段をさらに設けたことによって、各処理装 置の経時的な特性の変動をも考慮した様々な観点から最 適なプロセス条件を自動的に得ることが可能となり、プロセス条件設定のための人為的な試行錯誤を不要なもの とすることができる。

【0019】さらに、本発明は、被処理基板に対する所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、各制御装置より受信した一部のプロセスデータに基づいて各制御装置を制御するホストコンピュータと、各制御装置より受信したプロセスデータを収集し、前記収集したプロセスデータを解析し、前記解析の結果を出力し、前記収集したプロセスデータで前記ホストコンピュータのプロセスデータ受信不能期間の欠落プロセスデータを補填するコントロール装置とを具備し、前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手段と、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定された一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに送信する手段と、前記生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段を有する、20制御システムを提供する。

【0020】本発明は、コントロール装置で収集したプロセスデータでホストコンピュータのプロセスデータ受信不能期間の欠落プロセスデータを補填する手段をさらに設けたことで、ホストコンピュータはダウン状態から復旧した直後より、各処理装置の制御装置に対する制御を直ちに再開することができる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。

【0022】本発明に係る制御システムは、例えば次のような複合プロセス型の半導体ウエハ製造装置等に適用される。

【0023】図1に示すように、この半導体ウエハ製造 装置は、半導体ウエハに対して各種の処理例えばCVD 処理またはスパッタリング処理やエッチング処理や熱酸 化処理等を行う複数例えば3つののプロセスチャンバ 1、2、3と、多数枚例えば25枚のウエハWを収納で きるカセットC1、C2を収容するカセットチャンバ 4、5と、プロセスチャンパ1、2、3とカセットチャ 40 ンバ4、5との間でウエハWの受け渡しを行う搬送チャ ンバ6とを備えて構成される。各チャンバ間はゲートバ ルブGを介して開閉自在に連結されている。搬送チャン バ6内には、屈伸動作及び回転動作が可能な例えば多関 節式の搬送アーム7が設けられており、この搬送アーム 7によりチャンバ間でのウェハWの搬送が行われる。カ セットC1、C2はカセットチャンバ4、5内に取り込 まれる際に90度反転されると共にそのカセットC1、 C2のウエハ挿脱口が搬送チャンバ6内の中心を向くよ

入れが可能な姿勢に設置される。 図2に示す制御システムによると、処理装置11(11-1~11-N)は、例えばCVD処理またはスパッタリング処理、エッチング処理、熱酸化処理等の被処理基板に対する各種処理を行い、ECC制御部12(12-1~12-N)は各処理装置11の上位制御系であり、MC(マシンコントローラ)10(10-1~10-N)は各処理装置11の下位制御系である。

8

【0024】図3に示すように、ECC制御部12は、 ホストコンピュータ15との論理的なインターフェイス 手段であるHCI(Host Communication Interface)1 3を有し、このHCI13によって、ホストコンピュー タ15との間での各種データのやりとりがTCP/IP 等のデータ伝送系14を通じて行われる。また、ECC 制御部12は、アドバンスド・グループ・コントローラ (以下、AGCと称す)17との論理的なインターフェ イス手段であるRAP(Remote Agent Process)16を 有し、このRAP16によってAGC17との間での各 種データのやりとりがデータ伝送系14を通じて行われ る。

【0025】 ことで、プロセスデータ転送に係るHCI 13とRAP16の機能の違いについて説明する。

【0026】HCI13は、ECC制御部12にて処理 装置11から得た全てのプロセスデータの中から予め設 定された一部の種類のプロセスデータだけを選択してホ ストコンピュータ15に送信する。すなわち、図3にお いて、メモリ18はECC制御部12にて生成された全 プロセスデータを一時的に蓄積し、HCI13は、この メモリ18から予め設定された一部の種類のプロセスデ つタ (データ1、3)を取り出してHCI送信バッファ 19に書き込み、HCI送信バッファ19の内容をまと めてホストコンピュータ15に送信する。また、HCI 13は、ECC制御部12で生成されたステータスデー タなどもホストコンピュータ15に送信する。

【0027】RAP16は、ECC制御部12にて処理 装置11から得た全てのプロセスデータを無条件にAG C17に送信する。すなわち、RAP16は、ECC制 御部12内のプロセスデータ蓄積用メモリ18に蓄積さ れたプロセスデータを先頭から順次読み出し、そのデー タ構造のままAGC17に転送する。但し、データの順 番を並び換えたり、どく一部のデータを排除する程度の 操作をここで行ってもよい。

【0028】ホストコンピュータ15は、各処理装置1 1のECC制御部12との間での各種データをやりとり を通じて各処理装置11のトラッキング処理を行うなど 各処理装置11の全体的な動作制御を行う。

セットC 1、C 2 はカセットチャンバ4、5内に取り込 【0029】AGC 17は、各処理装置毎のレシビ(ブまれる際に90度反転されると共にそのカセットC 1、ロセス条件値)の集中管理やレシビに基づく各処理装置C2のウエハ挿脱口が搬送チャンバ6内の中心を向くよ 11のプロセスコントロールをはじめとして、各処理装うに回転され、以て搬送アーム7によるウエハWの出し 50 置11から得られる全てのブロセスデータを対象に、そ

の解析処理、統計処理、プロセスデータやその解析/統計結果の集中モニタリング処理、更には解析/統計結果 をレシピに反映させる処理等を行う。

【0030】AGC17はAGCサーバ17aとAGC クライアント17bから構成されている。AGCサーバ 17aの通信 I / F (インターフェース部) 21は、各 処理装置 11のECC制御部12およびAGCクライアント17bとの間でデータ伝送系14を通じて各種テータを送受信する。EQM制御部22は、予め定義されたプロセス条件と各処理装置 11から得られるプロセスデ 10ータに基づいて処理装置毎のプロセスの各種パラメータの補正を行うとともに、受信したパラメータをデータベース23へ格納し、AGCクライアント17bに転送すべきプロセスデータをデータベース23から検索する処理等を主に行う。

【0031】AGCクライアント17bには、AGCサーバ17aより転送されてきたプロセスデータの解析処理および統計処理を行うデータ解析部25と、取り込んだプロセスデータやその解析結果等をクライアントユーザが利用し、加工できる形式のデータに変換するデータ変換部26と、変換データをモニタ等に表示するデータ表示部27と、被処理基板上の膜厚等の測定データを含むプロセスデータの解析結果に基づいてレシピ(プロセス条件)を最適化するように更新するレシピ修正部28等の機能が用意されている。

【0032】次に、このシステムの動作をAGCの関与する動作を中心に説明する。

【0033】まず、各処理装置11のECC制御部12は、AGC17によるプロセスコントロールの下で、対応する処理装置11を制御して被処理基板に対する処理 30を実行させる。

【0034】個々のECC制御部12にて処理装置11から得たプロセスデータは、図3に示したプロセスデータ蓄積用メモリ18に書き込まれる。プロセスデータ蓄積用メモリ18に書き込まれたプロセスデータは、その外部転送に係る論理的なインターフェイス手段であるHCI13とRAP16によって、TCP/IP等のデータ伝送系14の独立したチャンネルを通じてホストコンピュータ15とAGC17に転送される。

【0035】 CCで、HCI13は、プロセスデータ蓄 40 積用メモリ18 に保持されたすべてのプロセスデータの中から予め設定された一部の種類のプロセスデータだけを引き出してHCI送信バッファ19 に書き込み、HCI送信バッファ19 の内容をデータ伝送系14を通じてホストコンピュータ15 に送信する。一方、RAP16は、プロセスデータ蓄積用メモリ18から全てのプロセスデータを読み出してAGC17 に転送する。

【0036】AGC17(AGCサーバ17a)は、各 ライアント17bはレシピデータの編集を行う。編集処処理装置のECC制御部12のRAP16によって送信 理が終了すると、クライアント17bは編集済みのレシされたプロセスデータを受信し、とのプロセスデータを 50 ピデータをデータベース23に告き込む。これによりデ

10

データベース23 に蓄積するとともにこのプロセスデータとレシピデータから各処理装置のパラメータ補正値を 生成してこれをECC制御部12 に送信することによってプロセスコントロールを行う。

【0037】また、AGCサーバ17aは、AGCクライアント17bからプロセスデータ転送要求を受けると、データベース23から該当するプロセスデータを読み出し、通信I/F21を通じてAGCクライアント17bに転送されたプロセスデータは、データ変換部26にてクライアントユーザが利用し、加工できる形式のデータに変換され、データ表示部27によってモニタに表示される。さらに、AGCクライアント17bに転送されたプロセスデータは、データ解析部25にて解析および統計処理され、その解析結果はデータ変換部26にてプロセスデータと同様にユーザ利用可能な形式のデータに変換され、モニタに表示される。これによりAGCクライアント17b上での基板処理システム全体の一元管理が実現される。

【0038】また、AGCクライアント17bのデータ解析部25は、プロセスデータの解析結果から処理装置の異常検出や異常予測を行い、異常を検出した場合および予測した場合は、その旨をデータ表示部27を通してモニタに出力するとともにAGCサーバ17aに通知する。この通知に従ってAGCサーバ17aは、例えば、異常検出或いは異常予測された処理装置11を制御しているECC制御部12に対して処理装置の停止を指示するなどの制御を行う。

【0039】さらに、AGCクライアント17bのレシビ修正部28は、基板上の膜厚測定結果等の測定データを含むプロセスデータに対する解析結果からレシビ(プロセス条件)を最適化するための修正処理を行う。

【0040】また、本実施形態では、ホストコンピュータ15がダウンした場合にAGCI7によるプロセスデータのスプーリング処理が行われる。すなわち、ホストコンピュータ15は、復旧後、ダウン期間のプロセスデータをAGCから直ちに取り込むことができる。これにより、ホストコンピュータ15による各処理装置11のトラッキング処理を復旧後直ちに再開することができる。

【0041】次に、上記制御システムにおいてレシピデータを編集して処理を実行する動作を図5を参照して説明する。

【0042】まず、AGCクライアント17bはAGCサーバ17aを介してデータベース23に対してレシビデータの読み込みを行う。データベースから読み出されたレシビデータがクライアント17bに送られると、クライアント17bはレシビデータの編集を行う。編集処理が終了すると、クライアント17bは編集済みのレシビデータをデータベース23に供き込む。これによりデ

ータベース23のレシピデータが更新される。

【0043】一方、ホストコンピュータ15が処理装置 11-1に対して処理開始命令、例えば処理に対応する レシピID情報を出すと、処理装置11-1のECC制 御部12-1はAGCサーバ17aのEQM22にレシ ピID情報に対応するレシビデータを要求する。AGC サーバ17aはこの要求に対してAGCサーバのデータ ベース23からレシピデータを読み出し、処理装置11 -1のECC制御部12-1に転送する。処理装置11 する。このとき、処理装置11-1のECC制御部12 - 1 は処理実行中に発生する実際の処理データを保存す る。

11

【0044】なお、処理装置11-1のECC制御部1 2-1に転送されたレシビデータを処理装置 11-1と 同じ処理を行う他の処理装置にコピーすることができ、 このコピーされたレシピデータに従って他の処理装置、 例えば処理装置11-2.11-3は処理装置11-1 と同じレシビデータに従って処理を実行することができ る。従って、処理装置 1 1 - 1 ~ 1 1 - 3 は A G C サー 20 バにより一括管理できる。

【0045】上記実施形態では、データベース23に格 納されたレシビデータに従って処理が行われているが、 データベース23を使用しない実施形態での制御システ ムの動作を図6を参照して説明する。

【0046】Cの実施形態では、AGCクライアント1 7 b が A G C サーバ 1 7 a を介して例えば処理装置 1 1 -1のECC制御部12-1にレシピ要求を行う。EC C制御部12-1は要求に応じて保存しているレシビデ ータをAGCサーバ17aを介してクライアント17b に転送する。レシピデータを受けたクライアント 17 b はレシピデータに対して編集処理を行う。レシピデータ の編集が終わると、クライアアント17bはAGCサー バ17aを介して処理装置11-1のECC制御部12 - 1 にレシピデータの登録要求を出す。 E C C 制御部 1 7 a はレシピデータを登録すると共にタイムスタンプを 記録する。

【0047】次に、同じ編集レシピデータを他の処理装 置11-2のECC制御部12-2にコピーするために ECC制御部12-2に登録要求をする。ECC制御部 12-2はCの登録要求に対してACKを出すと、AG Cサーバ17aはレシピデータの登録を行う。

【0048】上記のようにしてレシピデータが編集され た後に、ホストコンピュータ15から処理実行命令を例 えば処理装置11-1に出すと、処理装置11-1のE CC制御部12-1はレシピ実行承認要求をAGCサー バ17aに送る。AGCサーバ17aはタイムスタンプ をチェックし、ECC制御部12-1に対して実行承認 ACKを送る。これにより、処理装置11-1はレシビ データに従って処理を実行する。この処理実行により発 50 ロセスデータを蓄積するサーバ装置を、予め決められた

生する実際データはECC制御部12-1に逐次保存さ れる。

12

【0049】以上説明したように、本実施形態の制御シ ステムによれば、各処理装置から得られる全て或いはほ ば全ての詳細なプロセスデータをAGC17に取り込ん で集中モニタリングすることができるので、各処理装置 の状態として掴むことのできる情報の幅が広がり、処理 装置の異常や劣化状態をより詳細かつ早期に発見すると とができる。また、各処理装置から得られる全て或いは - 1 は送られたレシピデータに従って所定の処理を実行 10 ほぼ全ての詳細なプロセスデータを解析してその解説結 果を集中モニタリングすることができるので、各処理装 置の状態の経時的な変化を早期に発見することができ る。これにより、多数の処理装置からなる製造システム の保守信頼性を髙めることが可能となる。また、本実施 形態では、基板上の膜厚測定結果等の測定データを含む 詳細なプロセスデータに対する解析結果や統計結果から レシピにおける各データをより好ましい値に更新すると とによって、各処理装置の経時的な特性の変動をも考慮 した様々な観点から最適なプロセス条件を自動的に得る ことが可能となり、信頼性の向上を図ることができる。 【0050】さらに、AGC17をハード的にプロセス データ収集用のAGCサーバ17aと、そのプロセスデ ータを実際に運用するAGCクライアント17bとに別 けたことで、各々の制御負荷が分散され、より多数の処 理装置を接続した構成においても性能が低下することが なくなる。

> 【0051】なお、以上説明した実施形態において、A GC17は一台のAGCサーバ17aと一台のAGCク ライアント17bとで構成したが、処理装置の接続数が さらに増大した場合、AGCサーバ17aの負荷が非常 に大きくなることが予想される。そこで、図4に示すよ うに、機能例えばレシピの種類毎にAGCサーバ17a (17a-1~17a-M)を設ける形態をとる方式が 考えられる。とのような形態をとった場合、個々のAG Cサーバの機能をバージョンアップしたり保守点検を行 う際に、他のAGCサーバの管理下にある処理装置群の 動作を止める必要がなくなり、システム全体の処理効率 を髙めるととが可能となる。

【0052】さらに、本発明の制御システムによれば、 従来のホストコンピュータ上でプロセスデータを集中モ ニタリングする方式に比べ、より詳細なプロセスデータ の集中モニタリングが可能となり、処理装置の異常や特 性劣化を早期に発見することが可能となる。また、プロ セスデータを収集、表示するコントロール装置のハード ウェアをサーバ装置とクライアント装置とに分離し、ブ ロセスデータの収集、表示のための制御負荷を分散化し たことで、接続可能な処理装置数を増加することができ る。

【0053】また、本発明の制御システムによれば、ブ

13

前記処理装置のグルーブ毎、例えば同一のプロセス条件が設定された処理装置毎に設けたことで、接続可能な処理装置数をさらに増加させることができるとともに、個々のサーバ装置の機能をバージョンアップしたり保守点検を行う際に、他のサーバ装置の管理下にある処理装置群の動作を止める必要がなくなる。

[0054]

【発明の効果】以上説明したように本発明の制御システムによれば、コントロール装置は各処理装置の制御装置で生成された全てのプロセスデータを解析してその結果 10を出力するので、従来のホストコンピュータ上で一部のプロセスデータを集中モニタリングする方式に比べ、各処理装置の状態として掴み得る情報の幅が広がり、各処理装置の状態の経時的な変化も早期に発見することができる。

【0055】また、各制御装置にて生成された全てのプロセスデータの解析結果に基づいてプロセス条件を更新する手段をさらに設けたことによって、各処理装置の経時的な特性の変動をも考慮した様々な観点から最適なプロセス条件を自動的に得ることが可能となり、プロセス 20条件設定のための人為的な試行錯誤を不要なものとすることができる。

【0056】さらに、本発明の制御システムによれば、コントロール装置で収集したプロセスデータでホストコンピュータのプロセスデータ受信不能期間の欠落プロセスデータを補填する手段をさらに設けたことで、ホストコンピュータはダウン状態から復旧した直後より、各処理装置の制御装置に対する制御を直ちに再開することが*

*できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る制御システムの制御対象である複合プロセス型の半導体ウェハ製造装置の概略構成図

14

【図2】本発明の第1の実施形態である制御システムの ブロック図

【図3】図2のECC制御部のブロック図

【図4】本発明の第2の実施形態である制御システムの ブロック図

【図5】レシビ編集処理の手順を示すシーケンス図 【図6】他のレシビ編集処理の手順を示すシーケンス図 【符号の説明】

11 (11-1~11-N) ······処理装置

12 (12-1~12-N) ……ECC制御部

13 HCI

14……データ伝送路

15……ホストコンピュータ

16 ····· RAP

17 AGC

17a……AGCサーバ

17b ······ AGCクライアント

21……通信 I / F

22 ····· E QM制御部

23……データベース

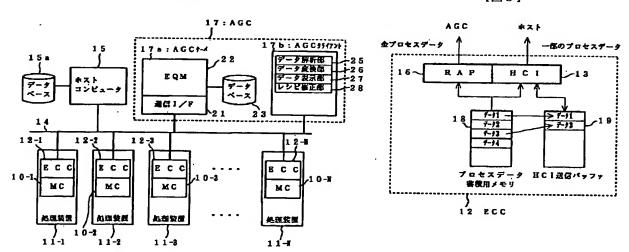
25……データ解析部 26……データ変換部

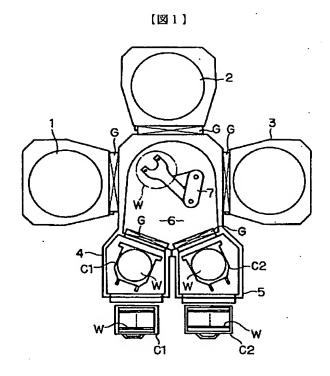
27……データ表示部

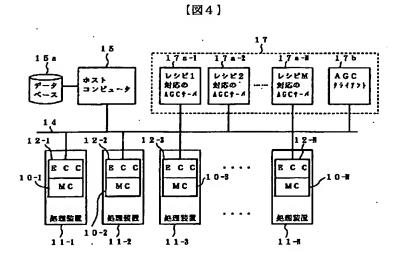
28……レシピ修正部

【図2】

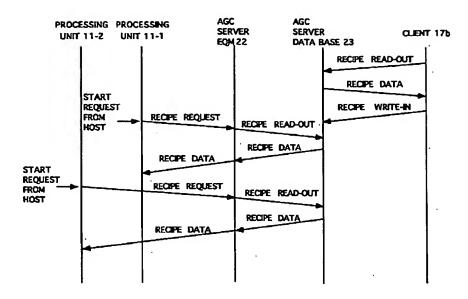
[図3]



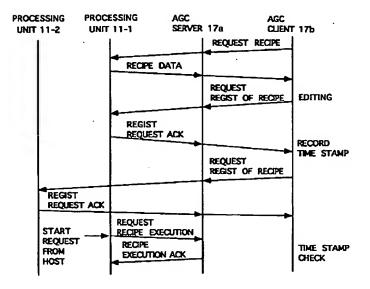




【図5】



【図6】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成14年1月11日(2002.1.11)

【公開番号】特開平11-74170

【公開日】平成11年3月16日(1999.3.16)

【年通号数】公開特許公報11-742

【出願番号】特願平10-168160

【国際特許分類第7版】

H01L 21/02 G05B 19/048 23/02 301 G06F 3/00 652 17/60 [FI] H01L 21/02 Z G05B 23/02 301 N G06F 3/00 652 C G05B 19/05 D

【手続補正書】

G06F 15/21

【提出日】平成13年6月21日(2001.6.2 1)

R

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に対して所定の処理を行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、

前記制御装置の各々で生成されたほぼ全てのプロセスデータを取り込んで蓄積する蓄積部を有するサーバ装置と、前記サーバ装置から前記蓄積されたプロセスデータを取り込み編集する編集部と、編集データを表示する表示部を有するクライアント装置を含むコントロール装置と、

を有することを特徴とする制御システム。

【請求項2】 前記制御装置は、ホストコンピュータからのコマンドに応答して対応する前記処理装置をそれぞれ制御することを特徴とする請求項1記載の制御システム。

【請求項3】 前記クライアント装置は、前記プロセスデータの解析処理および統計処理を行うデータ解析部と、取り込んだプロセスデータやその解析結果をユーザが利用し、加工できる形式のデータに変換するデータ変換部と、変換データを表示する前記表示部と、被処理基板上の膜厚等の測定データを含むプロセスデータの解析結果に基づいてレシビを最適化するように更新するレシ

ビ修正部を含むことを特徴とする請求項 l 記載の制御システム。

【請求項4】 前記制御装置の各々は、ホストコンピュータからのコマンドを受けて前記処理装置を制御すると共に前記処理装置から得た全てのプロセスデータの中から予め設定された一部の種類のプロセスデータだけを選択してホストコンピュータに送信する制御部を有するととを特徴とする請求項1記載の制御システム。

【請求項5】 前記制御部は、全プロセスデータを蓄積するメモリと、このメモリから取り出された予め設定された一部の種類のプロセスデータを一時格納するバッファと、このバッファの内容をまとめてホストコンピュータに送信するインターフェースと、前記メモリの全プロセスデータを前記コントロール装置に送信するインターフェースとを有することを特徴とする請求項4記載の制御システム。

【請求項6】 前記サーバ装置は、予め定義されたプロセス条件と前記処理装置の各々から得られるプロセスデータに基づいて処理装置毎のプロセスの各種パラメータの補正を行うとともに、受信したパラメータを前記蓄積部へ格納し、前記クライアント装置に転送すべきプロセスデータを前記蓄積部から検索する処理を行うことを特徴とする請求項1記載の制御システム。

【 請求項7 】 前記サーバ装置は、データベースからレシピデータを読み出し、前記処理装置の前記制御装置にデータを転送し、前記処理装置はこの送られたレシピデータに従って所定の処理を実行することを特徴とする請求項1記載の制御システム。

【翻求項<u>8</u>】 複数のグループに分けられ、基板に対して所定のプロセスを行う複数の処理装置をホストコンピュータと関連して個別に制御する複数の制御装置と、前記処理装置のグループ毎に対応して設けられ、前記制御装置の各々で生成されたほぼ全てのプロセスデータを取り込んで蓄積する蓄積部を有する複数のサーバ装置と、前記サーバ装置から前記蓄積されたプロセスデータを取り込み編集する編集部と、編集データを表示する表示部を有するクライアント装置とを含むコントロール装置と、を有することを特徴とする制御システム。

【請求項<u>9</u>】 前記クライアント装置は、前記プロセスデータの解析処理および統計処理を行うデータ解析部と、取り込んだプロセスデータやその解析結果をユーザが利用し、加工できる形式のデータに変換するデータ変換部と、変換データを表示する前記表示部と、前記基板上の膜厚の測定データを含むプロセスデータの解析結果に基づいてレシビを最適化するように更新するレシビ修正部を含むことを特徴とする請求項<u>8</u>記載の制御システム。

【請求項10】 前記データ解析部は、プロセスデータの解析結果から前記処理装置の異常検出や異常予測を行い、異常検出した場合及び異常予測した場合は、前記表示部に出力するとともに、異常検出あるいは、異常予測された前記処理装置を制御している前記制御装置に対して前記処理装置の停止を指示する制御を行うことを特徴とする請求項9記載の制御システム。

【請求項<u>11</u>】 前記制御装置の各々は、前記ホストコンピュータからのコマンドを受けて前記処理装置を制御すると共に前記処理装置から得た全てのプロセスデータの中から予め設定された一部の種類のプロセスデータだけを選択してホストコンピュータに送信する制御部を有することを特徴とする請求項8記載の制御システム。

【請求項<u>12</u>】 前記制御部は、全プロセスデータを蓄積するメモリと、このメモリから取り出された予め設定された一部の種類のプロセスデータを一時格納するバッファと、このバッファの内容をまとめてホストコンピュータに送信するインターフェースと、前記メモリの全プロセスデータを前記コントロール装置に送信するインターフェースを有することを特徴とする請求項<u>11</u>記載の制御システム。

【請求項<u>13</u>】 前記サーバ装置は、予め定義されたブロセス条件と前記処理装置の各々から得られるプロセスデータに基づいて処理装置毎のプロセスの各種パラメータの捕正を行うとともに、受信したパラメータを前記蓄積部へ格納し、前記クライアント装置に転送すべきプロセスデータを前記蓄積部から検索する処理を行うことを特徴とする請求項8記載の制御システム。

【請求項<u>14</u>】 前記クライアント装置は同じグループ 内の前記処理装置に対応する前記制御装置に同じレシピ をコピーする機能を有することを特徴とする請求項8記 載の制御システム。

【請求項<u>15</u>】 各々が同一のプロセス条件に設定された複数の処理装置を含む複数のグループに分けられ、基板に対して所定のプロセスを行う複数の処理装置をホストコンピュータと関連して個別に制御する複数の制御装置と、前記グループ毎に対応して設けられ、プロセスデータを取り込み、編集する手段および変換データを表示する手段を有するクライアント装置を含むコントロール装置と、を有することを特徴とする制御システム。

【請求項<u>16</u>】 基板に対する所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記制御装置の各々で生成された一部のプロセスデータに基づいて前記制御装置を制御するホストコンピュータと、同一のプロセス条件が設定された処理装置のグループ毎に対応して設けられ、各制御装置で生成されたほぼ全てのプロセスデータを取り込んで蓄積する手段を有する複数のサーバ装置と、前記サーバ装置から前記蓄積されたプロセスデータを取り込み、編集するクライアント装置と、編集データを表示する手段とを有するクライアント装置を含むコントロール装置と、を具備することを特徴とする制御システム。

【請求項<u>17</u>】 基板に対して所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記制御装置の各々より受信したプロセスデータに基づいて前記制御装置の各々を制御するホストコンピュータと、前記制御装置の各々より受信したプロセスデータを収集する手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段 および前記解析の結果を出力する手段を有するコントロール装置と、を具備し、前記制御装置の各々は、ブロセスデータを生成する手段、前記生成されたプロセスデータを的設定された一部のプロセスデータを前記 ホストコンピュータに送信する手段および前記生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段を有することを特徴とする制御システム。

【請求項<u>18</u>】 前記コントロール装置は、前記収集したプロセスデータの内で前記ホストコンピュータが受信不能となった期間での欠落プロセスデータを補填する手段を有することを特徴とする請求項<u>17</u>記載の制御システム。

【請求項<u>19</u>】 基板に対して所定のプロセスを行う複数の処理装置を個別に制御する複数の制御装置と、前記制御装置の各々より受信したプロセスデータに基づいて前記制御装置を制御するホストコンピュータと、前記制御装置の各々より受信したプロセスデータを収集する手段、前記収集したプロセスデータを解析する手段および前記解析の結果に基づいて各処理装置のプロセス条件を更新する手段を有するコントロール装置と、を具備し、前記個々の制御装置は、プロセスデータを生成する手段、前記生成されたプロセスデータの中から予め設定された一部のプロセスデータを前記ホストコンピュータに

送信する手段および前記生成された全てのプロセスデータを前記コントロール装置に送信する手段を有することを特徴とする制御システム。

【請求項20】 前記コントロール装置は、前記収集し

たプロセスデータの内で前記ホストコンピュータが受信 不能となった期間での欠落プロセスデータを捕填する手 段を有することを特徴とする請求項<u>19</u>記載の制御シス テム。